

Abstract of the Disclosure

設計パターンの幅方向における両端の各エッジにそれぞれ隣接するエッジペアを認識し、このエッジペアが認識されたエッジ方向に基づいて設計パターンのエッジ点をサブ画素で検出し、このエッジ点から設計パターンの幅寸法を算出し、この設計パターンの幅寸法と同一位置で算出した回路パターンの幅寸法とに基づいて半導体ウエハの回路パターンに対する良否判定を行う。